

## NEW MULTI-FUNCTIONAL MICRO- AND NANOIMPRINT SOLUTION FROM EV GROUP OFFERS UNPRECEDENTED FLEXIBILITY FOR HIGH-VOLUME OPTICAL DEVICE MANUFACTURING – January 19, 2022

EV Group (EVG), a leading supplier of wafer bonding and lithography equipment for the MEMS, nanotechnology and semiconductor markets, today introduced the EVG®7300 automated SmartNIL® nanoimprint and wafer-level optics system. The EVG7300 is the company's most advanced solution to combine multiple UV-based process capabilities, such as nanoimprint lithography (NIL), lens molding and lens stacking (UV bonding), in a single platform. This industry-ready, multi-functional system is designed to serve advanced R&D and production needs for a wide range of emerging applications involving micro- and nano-patterning as well as functional layer stacking.

中国科技头条  
www.srolzw.ml

新闻 媒体 产品 服务 | 汽车 机械 材料 能源 医药 教育 评论 动漫 电商 军事 文化 国内 国际 社会 历史

### EV集团新型多功能微纳米压印解决方案为大批量光学设备制造赋予前所未有的灵活性

中国科技头条 admin3 2022-01-19 10:50

EVG®7300是EV集团最先进的解决方案，能够在单个平台中结合多种紫外工艺，包括纳米压印光刻 (NIL)、透镜成型和透镜堆叠 (UV键合)。

**2022年1月19日，奥地利莱奥施坦 -** 微机电系统 (MEMS)、纳米技术和半导体市场紧密地与光刻设备供应商EV集团 (EVG) 推出EVG®7300自动化SmartNIL纳米压印与晶圆级光学系统。EVG7300是EV集团最先进的解决方案，在单个平台中结合了多种紫外工艺技术，包括纳米压印光刻 (NIL)、透镜成型和透镜堆叠 (紫外键合)。该设备向行业的多功能系统存在满足多种不同应用的发展生产需求。当前紫外应用大多涉及微米和纳米级加工功能制造单元技术，包括晶圆级光学系统 (WLO)、光学传感器和探测器、汽车照明、增强现实耳机透镜、生物医学设备、透镜和透镜表面，以及光电子学应用。EVG7300支持最大300毫米晶圆尺寸，具有高精度、先进工艺控制和符合批量等优势，可满足多种自由度和高精度纳米和微光学元件与器件的大批量制造需求。



EVG7300自动化SmartNIL纳米压印与晶圆级光学系统在一个平台中结合了多种紫外工艺技术，是新一代多功能解决方案。

EV集团企业技术总监托马斯·格林斯纳 (Thomas Glinzner) 表示：“EV集团深耕纳米压印技术领域二十余年，我们将继续在这一重要领域开拓创新，开发出新型解决方案，满足不断变化的客户需求。EVG7300是EV集团纳米压印解决方案系列的最新成员，将我们的SmartNIL全场压印技术与透镜成型和透镜堆叠技术结合于该平台，拥有市场上最精确的测量和工艺参数控制功能，为我们的客户带来了前所未有的灵活性，足以满足行业研究和生产需求。”

EVG7300系统既可作为独立工具，也可用作EV集团eRCL/ES® NIL全圆成型UV-NIL晶圆解决方案中的集成模块。UV-NIL解决方案可增加额外的预处理步骤，例如涂胶流程、抗蚀剂涂胶、烘焙或显影处理，以满足特定工艺的文化需求。EVG7300系统结合了高平台改造、高精度光学、多点跟踪控制、非接触式轮廓测量和多点力控制技术，达到了业内领先的精度精度（最低可达300纳米）。EVG7300是一种高度灵活的平台，提供三种工艺模式（透镜成型、透镜堆叠和SmartNIL纳米压印），支持从150毫米到300毫米晶圆的基板尺寸。该高效平台能够快速加载和晶圆，快速清洗光学器件，提供高功率激光功能。且工具尺寸小巧，能够充分满足行业对新型晶圆级光学系统 (WLO) 产品的制造需求。



SmartNIL平台配备了先进的紫外光刻技术，能够实现微米级加工精度，满足对WLO产品的高精度生产需求。